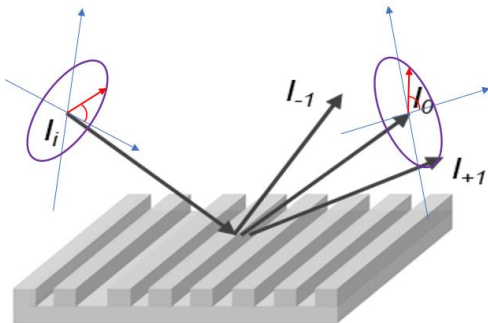
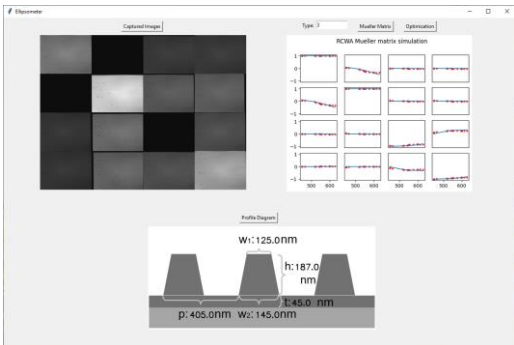
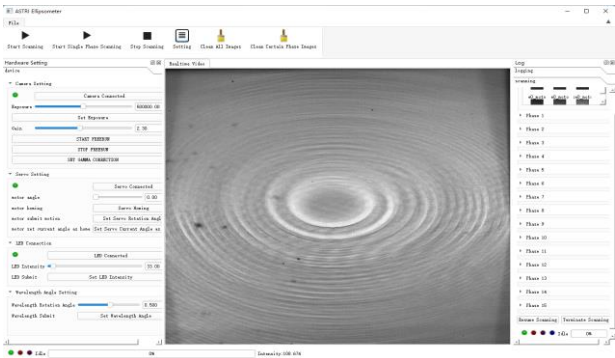


成像椭偏仪-微纳结构量测系统
Imaging ellipsometry---measurement for micro-nano optics

硬件设备采集偏振态改变

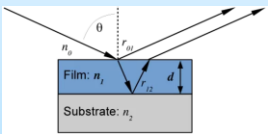


软件系统采集控制，结构反演



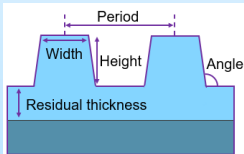
超表面结构量测

薄膜厚度



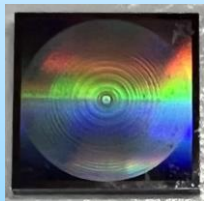
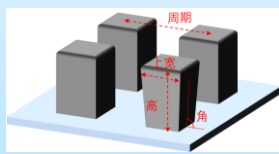
- ✓ 膜系表征
- ✓ 多点测量

一维光栅超表面



- ✓ 一维光栅超表面结构
- ✓ 周期，宽，高，残胶厚等
- ✓ 矩形，梯形光栅

二维超表面



- ✓ 二维超表面结构
- ✓ 周期，宽，高，倾角等
- ✓ 立方柱，圆柱等纳米柱